

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成30年7月12日(2018.7.12)

【公表番号】特表2017-522726(P2017-522726A)

【公表日】平成29年8月10日(2017.8.10)

【年通号数】公開・登録公報2017-030

【出願番号】特願2016-573865(P2016-573865)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 1

H 01 L 21/304 6 2 2 N

【手続補正書】

【提出日】平成30年5月28日(2018.5.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

粒子除去のための装置であって、  
基板支持面を有する基板固定装置と、

粒子状物質清掃用品を受容し、基板支持面の上方に、また基板支持面に接して、前記粒子状物質清掃用品の経路を有するように構成された供給アセンブリ及び巻上げアセンブリと、

前記粒子状物質清掃用品と基板とを分離するように構成された基板配置装置と  
を含む装置。

【請求項2】

前記基板配置装置は、複数のリフトピンを含む、請求項1に記載の装置。

【請求項3】

前記粒子状物質清掃用品は、その中に形成される複数の開口部であって、前記複数のリフトピンに位置合わせされるように構成される複数の開口部を有する、請求項2に記載の装置。

【請求項4】

前記基板固定装置は、静電気力を提供するように構成された電極を含む、請求項1に記載の装置。

【請求項5】

前記粒子状物質清掃用品は織布である、請求項1に記載の装置。

【請求項6】

前記粒子状物質清掃用品は、前記基板支持面に対して非粘着性である、請求項1に記載の装置。

【請求項7】

前記基板配置装置は、ロボットアームを備える、請求項1に記載の装置。

【請求項8】

粒子除去のための方法であって、  
一又は複数の開口部を有する粒子状物質清掃用品が配置された基板支持面と、一又は複数のリフトピンとを有する基板固定装置に、基板の裏側の少なくとも一部分を固定するこ

とと、

前記基板を前記粒子状物質清掃用品から分離し、複数の粒子の少なくとも一部が前記粒子状物質清掃用品に付着して運ばれることと、

一又は複数の開口部が前記一又は複数のリフトピンの上方に配置されるように前記粒子状物質清掃用品に指標付けすることと  
を含む方法。

【請求項 9】

前記基板固定装置を横断して、前記粒子状物質清掃用品を前進させることを更に含む、  
請求項 8 に記載の方法。

【請求項 10】

固定することは、前記基板支持面の上に静電気力を生成すること又はロボットアームを使用して前記粒子状物質清掃用品に対して前記基板を配置することを更に含む、請求項 8 に記載の方法。

【請求項 11】

前記粒子状物質清掃用品はポリイミドを含む、請求項 8 に記載の方法。

【請求項 12】

粒子除去のための装置であって、

基板支持面と複数のリフトピンを有する基板固定装置と、

前記基板支持面の上方に配置される前進可能な粒子状物質清掃用品であって、その中に形成された複数のリフトピン開口部を有する粒子状物質清掃用品と、

前記基板固定装置の上に前記粒子状物質清掃用品を配置するための測定基準を提供する  
ように構成された光学検知装置と  
を含む装置。

【請求項 13】

前記光学検知装置は、前記粒子状物質清掃用品の位置と飽和の両方を決定する、請求項 1 2 に記載の装置。

【請求項 14】

前記基板固定装置は、静電気力を提供するように構成された電極を含む、請求項 1 2 に記載の装置。

【請求項 15】

前記粒子状物質清掃用品は、前記基板支持面の反対側に向いた前記粒子状物質清掃用品の側面に配置された粘着層を含む、請求項 1 2 に記載の装置。